

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 3 日 (03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/020243 A1

(51) 国際特許分類⁷: G12B 21/08, G01N 13/16

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009911

(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 12 日 (12.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-275200 2003 年 7 月 16 日 (16.07.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立
行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND
TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県
川口市本町四丁目 1 番 8 号 Saitama (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 大

(KOBAYASHI, Dal) [JP/JP]; 〒1570061 東京都世田谷
区北烏山八丁目 3 1 番 1 5-3 0 3 号 Tokyo (JP). 川
勝 英樹 (KAWAKATSU, Hideki) [JP/JP]; 〒1580086 東
京都世田谷区尾山台一丁目 9 番 1 8 号 Tokyo (JP).

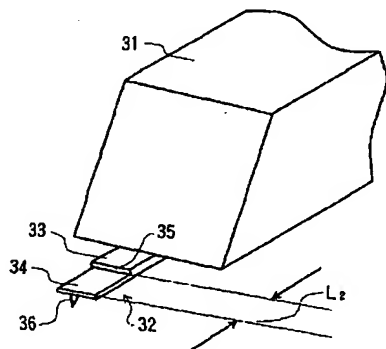
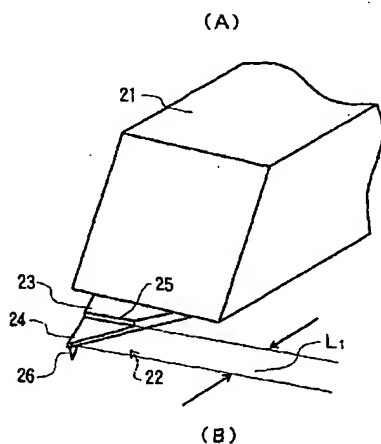
(74) 代理人: 清水 守 (SHIMIZU, Mamoru); 〒1010053 東京
都千代田区神田美土代町 7 番地 1 0 大園ビル Tokyo
(JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: PROBE FOR SCANNING PROBE MICROSCOPE AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 走査型プローブ顕微鏡のプローブおよびその製造方法



(57) Abstract: A probe for a scanning probe microscope and a method of producing the probe, where the probe is capable of performing accurate measurement without the base of a cantilever coming in contact with an object to be measured and without the object being hidden by the base of the probe. A probe for a scanning probe microscope has a base (21, 31), a cantilever (23, 33) for support, horizontally extending from the base (21, 31), and a cantilever (24, 34) for measurement, provided at the head of the supporting cantilever (23, 33) and having a length of 20 micrometers or less and a thickness of 1 micrometer or less.

(57) 要約: カンチレバーの基部が測定対象物に接触することがなく、かつ測定対象物がカンチレバーの基部によって隠されることがなく、的確な測定を行うことができる走査型プローブ顕微鏡のプローブおよびその製造方法を提供する。走査型プローブ顕微鏡のプローブの基部 (21, 31) と、この基部 (21, 31) から水平方向に伸びた支持用カンチレバー (23, 33) と、この支持用カンチレバー (23, 33) の先端に長さ 20 マイクロメートル以下で、厚さ 1 マイクロメートル以下の測定用カンチレバー (24, 34) が設置されるようにする。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。